

日立分析型場放射掃描式電子顯微鏡及 Bruker 背散射繞射系統(EBSD) 材料解析及應用研討會

HITACHI Analytical FE-SEM & Bruker EBSD system application seminar

主 題：「觀察、分析，無限想像」試想，如果不需要考慮樣品是否導電，不須鍍金處理，按個鈕切換模式，然後就可以繼續觀察，會有多便利。如果 SEM 機台能自己校正，自動對焦、自動調整亮度及對比，操作者只要選定地方，就能拍出理想的影像；觀察 無限想像！
日立 SU5000 分析型 FESEM，具有超高亮度的特性，提供電流大且穩定，搭載 EDS、WDS、EBSD 都能達到超乎想像的效果。
當然，沒有理想的樣品，就無法觀察到真實的結果。日立 IM4000+ 提供高速且無應力的 Ar 離子切割機，切割精度誤差在 $\pm 2\mu\text{m}$ ，且可搭載冷凍控溫功能，提供清楚的斷面分析。

所有材料都會含有大量不同種類的缺陷或不完美性[晶體缺陷]，缺陷的影響並非都是不好的，包括點缺陷、線缺陷(一維)和界面缺陷(二維)。Bruker Quantax EBSD 是目前最先進的 EBSD 系統，可清楚快速的解析各種界面缺陷，獨特的 Detector tilt 可調整角度設計，可取得最好的訊號角度。彩色的 FSE 影像，專利的 TKD(Transmission Kikuchi Diffraction)，讓分析數據有更多的細節，看清材料的真相！

參加對象：各表面分析實驗室、研發及製程等相關人員

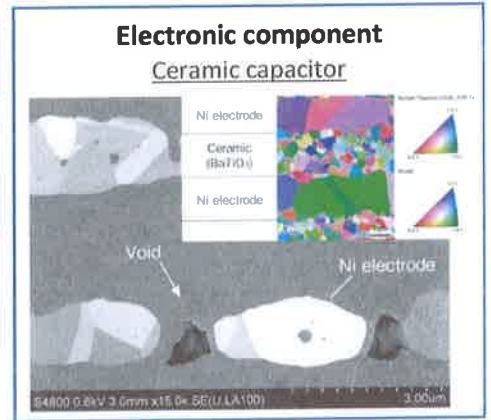
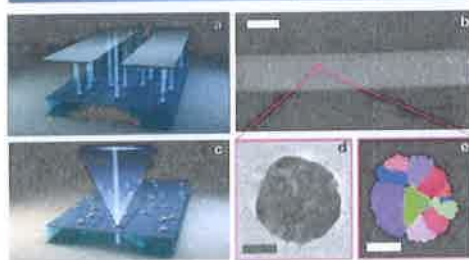
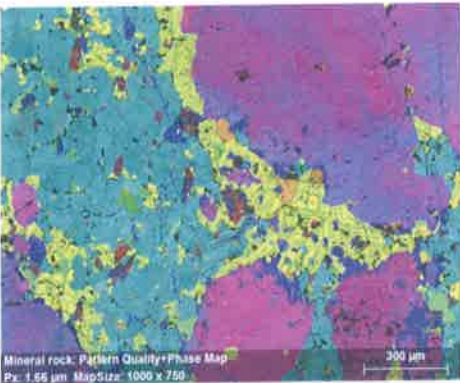
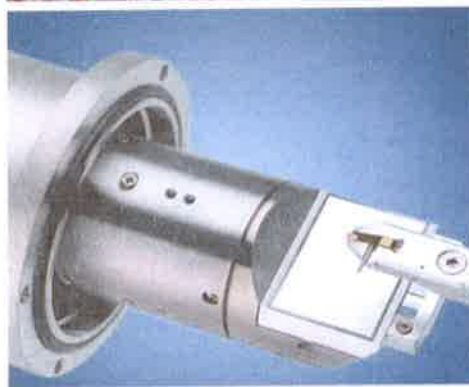
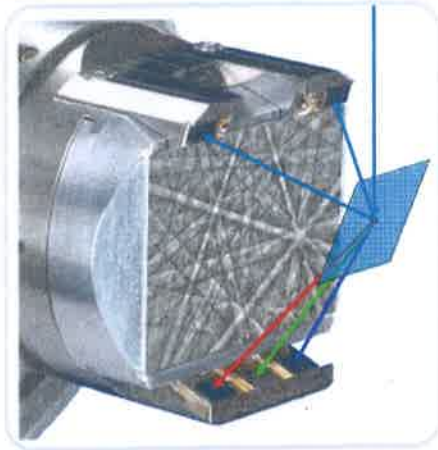
主辦單位：Hitachi High-Technologies/益弘儀器股份有限公司
Bruker Corporation

協辦單位：國立台灣大學理學院貴重儀器中心

時間地點：106/6/27 台灣大學理學院思亮館國際會議廳

講 師：益弘儀器電顯部 應用中心 郭瀚介
布魯克德國 EBSD 產品經理 Dr. Daniel Goran
布魯克 應用部 王銳

時 間	流 程	介 紹 人
09:00 – 09:20	報 到	
09:20 – 09:30	開場致辭	周必泰教授 (台灣大學-化學系)
09:30 – 10:30	HITACHI SU5000 Analytical FESEM 機台特性及影像解析應用	郭瀚介 應用工程師 (益弘)
	HITACHI IM4000 plus ION MILLING SYSTEM with 在樣品製作上的優勢及應用	郭瀚介 應用工程師 (益弘)
10:30 – 10:50	TEA TIME	
10:50 – 11:50	同軸 TKD OPTIMUS™-奈米級晶體分析的利器	Dr. Daniel Goran 產品經理(Bruker 德國)
11:30 – 12:20	微量元素分析的里程碑-Micro-XRF on SEM 讓您的電顯大放異彩	王銳 區經理 (Bruker)



報名方式：完全免費!即日起受理報名(額滿為止)，請立刻傳真至(02)27540439/
 ※確認報名成功專線：台北(02)27552266#310 Kelly

日立分析型場放射掃描式電子顯微鏡及 Bruker 背散射繞射系統(EBSD) 報名表

e-mail: kelly@ehong.com.tw

我要報名參加

單位 姓名		電話 e-mail	